

提 案 書

平成 24 年 7 月 23 日

学術院長 殿

教育研究技師部長

氏名 浅井 吉蔵

印

下記により教員候補者の選考について、提案しますので審議願います。

記

1 分 野 研究設備センターにおける高度技術支援

2 職 名 教育研究技師部 学術技師

3 業務内容

薬品、高圧、特殊ガス、それらを使用する設備の安全管理および利用者支援

4 提案理由

研究設備センターの施設の活用により、材料・デバイス、機械・ロボット、光・バイオの教育・研究分野での「ものづくり」、作製された「ものの評価」を一貫して行うことができる。「ものづくり」では、高圧ガス、特殊ガス、薬品が使用されることが多く、利用者への薬品・ガスに関する安全教育支援、安全面での緊急時や装置への迅速な対応を行い、大学の安全・衛生委員会と連携して高圧ガス、特殊ガス、薬品の安全使用及び管理、またこれらのガス、薬品を使った設備の安全利用や実験の実施支援

に積極的に関わる常勤の技術職員が現在おらず、必要不可欠である。薬品、高圧ガス、特殊ガスが使用されるクリーンルームをはじめ、大小 30 近くの半導体材料・デバイスプロセス、材料評価の設備の保守・管理を行い、上記分野での「ものづくり」、「もの評価」における教育、研究が円滑に行われるように実験を支援していただきたい。さらに、本学でのパスポートプログラムなどの実践的教育プログラムを充実させるには、最先端「ものづくり」の設備を活用した実習を支援する必要性が高まっている。

5 要件

- ・高等専門学校または大学を卒業して、半導体材料・デバイスプロセスの専門分野とガス、薬品の安全利用支援に関わる業務に対して熱意を有する者。上記に関する専門分野と担当業務に対しての経歴、専門知識があればなお望ましい。
- ・高特定高圧ガス取扱主任者資格所持者または特定化学物質取扱主任者（労働安全衛生法）あるいは、赴任後 2 年以内に取得予定者。

※赴任後に予定している業務

- ①東 8 号館高圧、特殊ガスの管理支援。
- ②新規利用者に対して安全教育補助（薬品、高圧、特殊ガスおよびそれらを使用する設備の扱いなど）
- ③緊急時に対応（安全面、装置面）
- ④半導体材料・デバイスプロセス、材料評価に関する 30 近くのすべての設備（クリーンルームを含む）の維持・管理支援
- ⑤大学の安全・衛生委員会と連携し、学内のガス、薬品およびそれらを使った設備の安全利用、実験の支援、
- ⑥緊急時に対応（安全面、装置面）
- ⑦装置の修理、安全点検などの立会い
- ⑧本学の実践的教育プログラムなどで、半導体材料・デバイスプロセス、ナノ材料評価に関する教育・研究支援補助

4 その他

※次の事項を記載のこと

公募／昇任の別

公募による新規採用

配置案（専攻、コース）

研究設備センター

任用予定年月日

平成 25 年 4 月 1 日以降のできるだけ早い時期